

РАСПАД ИЗОЛИРОВАННОГО ОТ СТЕНОК ВОЛНОВОДА
ПОТОКА БЕССТОЛКОВИТЕЛЬНОЙ ПЛАЗМЫ,
ВЗАИМОДЕЙСТВУЮЩЕГО С СВЧ ИЗЛУЧЕНИЕМ

В. И. Баринов, И. Р. Геккер, В. А. Иванов

УДК 533.95

Исследуется распад плазмы, взаимодействующей с интенсивным импульсным СВЧ излучением. Измеряются энергии и токи ускоренных электронов, выходящих из "скин-слоя" на переднем фронте плазменного потока, имеющего резкую границу.

Одним из актуальных вопросов при решении проблемы управляемого синтеза является нагрев плазмы электромагнитным излучением, в частности, лазерный метод при создании лазерной плазмы. Возможный механизм поглощения энергии волны в плазме может быть связан с аномальной диссипацией, обусловленной развитию неустойчивости плазмы. Для понимания физики протекающих при этом процессов существенно проведение моделирующих экспериментов в различных диапазонах длин волн.

При взаимодействии электромагнитного излучения 10-см диапазона с потоками бесстолкновительной незамагниченной плазмы ($n/n_c = 0,4 \div 2,0$ где n_c - критическая концентрация плазмы; $T_e \approx 5$ эв $\gg T_1$), заполняющими все сечения металлического волновода, начиная с некоторого значения напряженности электрического поля бегущей волны $E_0 > E_{\text{пор}} \approx 0,1$ кв/см, наблюдалась аномальная диссипация энергии волны в плазме, проявляющаяся в аномально большом поглощении /1-3/, появлении ускоренных электронов /3,4/ и распаде плазмы /2/. Распад плазмы и ускоренные ионы также отмечались в экспериментах с ограниченными плазменными потоками /5,6/. Поскольку при контакте плазмы с поверхностью волновода определенную роль могли играть

пристеночные явления, то авторами /7/ было проведено изучение аномального поглощения СВЧ волны в плазменном потоке, оторвавшем порывачально от стенок волновода. В частности, было показано, что

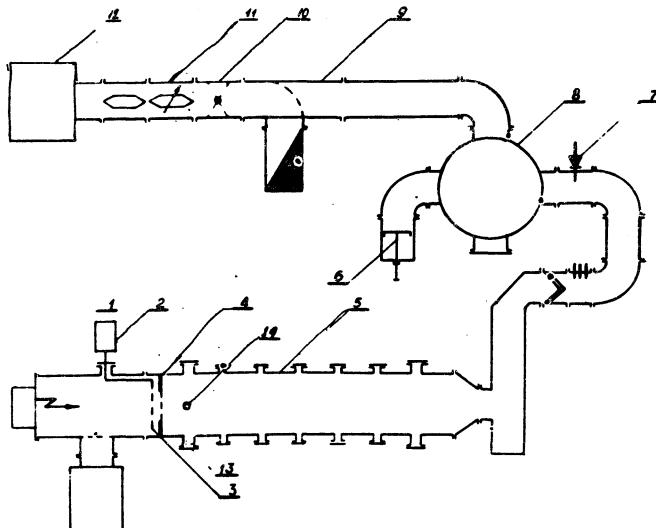


Рис. I. Схема экспериментальной установки. I - плазменный покровистый источник; 2 - блокинг-генератор; 3 - отсекающая плазму медная сетка (ячейка $0,03 \times 0,03 \text{ мм}^2$); 4 - металлическая диафрагма ($\varnothing 8$ и 3 см); 5 - вакуумный волновод; ($\varnothing 14 \text{ см}$); 6 - короткозамыкающий поршень; 7 - СВЧ - зонд; 8 - волноводный переключатель; 9 - направлений ответвитель; 10 - согласующая секция; II - ферритовый вентиль - регулируемый ослабитель; 12 - СВЧ генератор; 13 - многосеточный плазменный зонд; 14 - экранированный плазменный зонд.

по крайней мере, для коротких СВЧ импульсов ($\tau \approx 0,5 \text{ мксек}$) контакт плазмы с металлическими поверхностями не оказывался на величине коэффициента поглощения $|D|^2$. В данной работе проводится исследование распада изолированного от стенок волновода потока плазмы, измерение токов и энергии ускоренных электронов и соопоставление полученных результатов с данными по СВЧ поглощению.

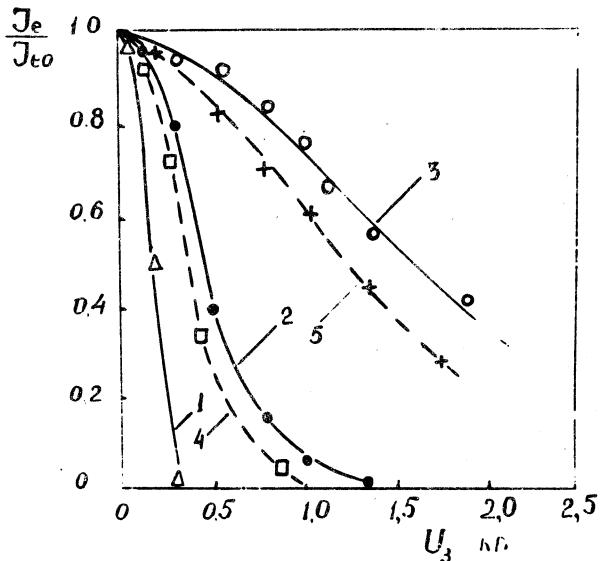
Эксперименты проводились на установке с H_{11} -волной /7/. Плазма, создаваемая искровым источником, инжектировалась ($v \sim 10^7 \text{ см/сек}$)

в металлический волновод \varnothing 14 см через затянутую редкой сеткой диафрагму \varnothing 8 см (или \varnothing 3 см), располагаемую в 60 см от источника (рис. I). Формирование крутого плазменного фронта протяженностью не выше 3 см, т.е. порядка $0,1 \lambda_g$, где λ_g - длина волны в волноводе, обеспечивалось подачей отрицательного импульса на дополнительную металлическую сетку, расположенную в 1 см от диафрагмы /7,8/. При этом получался однородный по концентрации цилиндрический участок плазменного потока длиной около 15 см (неоднородность не выше $\pm 10\%$ от значения концентрации в средней части потока). Значения концентрации плазмы измерялись с помощью экранированного плазменного зонда (точность измерений $+10\%$). При определении абсолютных значений и зонд калибровался по минимальному порогу развития неустойчивости (v_E/v_{Te})пор (где $v_E = eE_0/m\omega_0$ - скорость осцилляций электрона и $v_{Te} = \sqrt{kT_e/m}$ - тепловая скорость), соответствующему $n/n_c = 1/5,9\%$. Порог неустойчивости отождествлялся с порогом появления ускоренных электронов, регистрируемых многосеточным зондом, работавшим в целях повышения чувствительности в "интегральной" режиме /4/ и располагаемом в одном сечении с экранированным зондом.

Плазма взаимодействовала с H_{11} -волной, мощность которой могла повышаться до 1 Мвт. СВЧ импульсы длительностью $t \approx 0,5$ мксек подавались в тот момент, когда передний фронт плазмы перемещался примерно на расстояние в 10 см от диафрагмы. Измерения, проведенные на малом уровне СВЧ мощности, показали наличие почти полного отражения H_{11} -волны ($|D|^2 \approx 0$) от переднего фронта движущегося плазменного потока (при $n/n_c \geq 0,9$). Возрастание уровня СВЧ мощности приводило к уменьшению отражения ($|D|^2 \approx 0,1$ при $E_0 = 3,6$ кв/ом) и самому распаду плазмы, сопровождавшему вылетом ускоренных частиц /7/.

Распределение быстрых электронов по энергиям ($W_e > eU_a$, где $U_a = -20$ - потенциал антидиодронарной сетки) измерялись одновременно с помощью двух многосеточных зондов (МСЗ), располагаемых в боковых патрубках волновода в одной плоскости и двух взаимно перпендикулярных направлениях: параллельно и перпендикулярно к вектору напряженности электрического поля волны \vec{E} (рис. I). Из криевых задержек, приведенных на рис. 2, следует, что при $n/n_c > 1$ и $E_0 = 3,6$ кв/см появляются ускоренные электроны с энергией 2 кэв

и выше, что почти на два порядка превышает энергию их осцилляторного движения в СВЧ поле (см. также /3,4/). Энергия электронов, вылетающих из дифрагированного плазменного потока, оказывается примерно одинаковыми во всех направлениях (однако, несколько мень-



Р и с. 2. Кривые задержки тока быстрых электронов, покидающих плазменный поток ($n/n_e = 0,9 \div 1,5$). 1 - $E_0 = 0,35$ кв/см; 2 - $E_0 = 1,5$ кв/см; 3 - $E_0 = 3,6$ кв/см (все для $M_3 \parallel E$); 4 - $E_0 = 1,5$ кв/см; 5 - $E_0 = 3,6$ кв/см (все для $M_3 \perp E$).

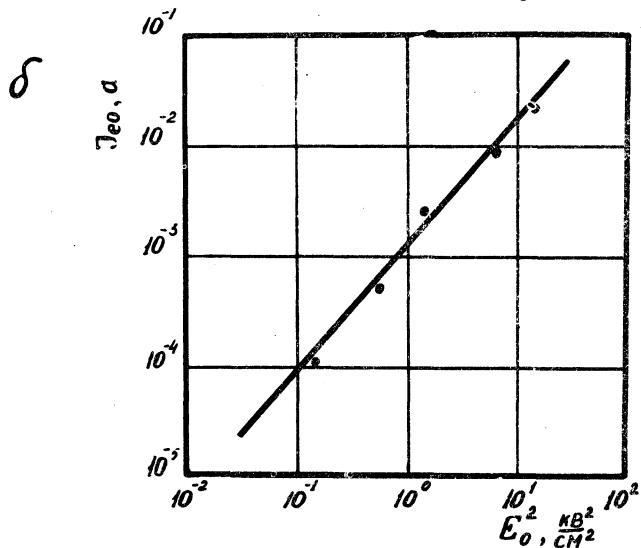
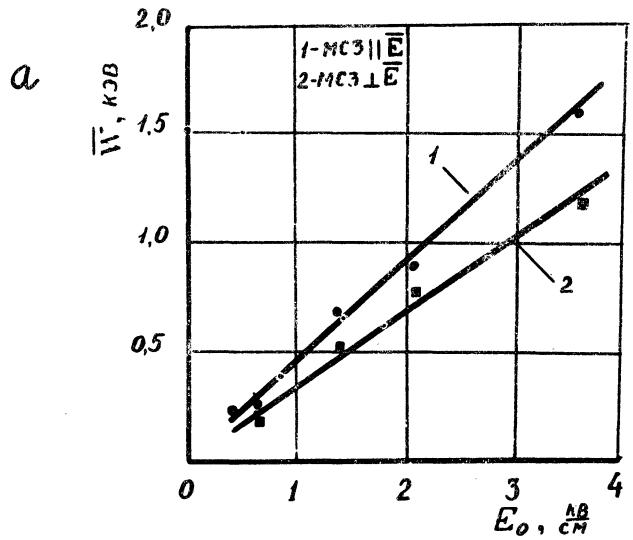
шими в направлении, перпендикулярном \vec{E}). Плотность тока ускоренных электронов вдоль направления \vec{E} превышает в 2-5 раз плотность тока, измеренную поперек \vec{E} . При этом анизотропия токов убывает с возрастанием уровня СВЧ мощности. Отметим далее, что указанная анизотропия, которая могла быть вызвана неоднородностью поля по сечению потока, сохраняется и при уменьшении диаметра потока до 3 см, когда электрическое поле становится практически однородным в пределах сечения потока. Наблюдаемые явления, по-видимому, можно связать с тем, что электроны, первоначально ускоренные вдоль \vec{E} , испытывают рассеяние как на грахиках плазменного потока, так

и на ионно-звуковых колебаниях плазмы. Последние имают в нашем случае частоту около 5 МГц и, как показали измерения с помощью двойного зонда с плавающим потенциалом, возникают одновременно с появлением ускоренных электронов, что не противоречит представлениям о развитии параметрической неустойчивости плазмы /9/.

Средняя энергия быстрых электронов, вылетающих как вдоль, так и поперек \vec{E} , растет почти линейно с увеличением E_0 (рис. 3а), а плотность тока электронов примерно пропорционально E_0^2 (рис. 3б). Средние энергии быстрых электронов и плотность их тока слабо зависят от концентрации плазмы в случае $n/n_c = 0,9 \div 1,5$. При $n/n_c < 0,9$ энергия и плотность тока резко падают. Таким образом, поток энергии Σ , перенесенный быстрыми электронами в единицу времени, растет как E_0^3 , т.е. как $r^{3/2}$, а отношение $\eta = \Sigma/P$, характеризующее эффективность поглощения, растет как $r^{1/2}$, т.е. как E_0 . Такой же рост, по-видимому, имеется и для $|D|^2/\%$. По порядку величин значение поглощенной СВЧ энергии совпадает с энергией, уносимой из "скин-слоя" быстрыми электронами. Возможно, что заметная доля энергии уносится также ионной компонентной плазмы /1/.

Изменяя задержку времени между моментом прохождения крутого переднего фронта плазменного потока через плоскость расположения многосеточных зондов и моментом запуска СВЧ генератора, удалось установить, что интенсивный вылет быстрых электронов происходит из узкого слоя плазмы протяженностью в 5-7 см ("скин-слой") на переднем фронте плазменного потока при изменении в широком диапазоне значений E_0 . Примерно на такую же глубину происходит распад плазмы на переднем фронте потока за время меньшее 0,5 мксек при максимальном значении $E_0 = 3,6$ кв/см (при этом концентрация падает более, чем в 20 раз), что устанавливается с помощью измерений с миниатюрными сканированными зондами (внешний диаметр 3 мм), квадратными в волновод перпендикулярно к E . В случае потока малого диаметра (ϕ 3 см) вылет быстрых электронов происходит по всей его длине.

Отключение системы электрической отсечки плазмы, формирующей крутой фронт плазменного потока, существенно не изменило v_{th} в наиболее плотной части потока, как и в случае экспериментов по поглощению СВЧ мощности /7/, не приводило к заметным изменениям результатов измерений.



Р и с. 3. Энергетические зависимости быстрых электронов ($n/n_c = 0,9 \div 1,5$; $U_a = -50$ в). а - средняя энергия электронов энергии и тока в функции E_c ; б - ток электронов в функции E_c^2 .

Как и в работе /7/ для проверки влияния контакта плазмы со стенками волновода в плазменный поток разных диаметров (ϕ 8 и 3 см) вводилась нормально к \vec{E} медная пластинка (ось пластинки находилась в плоскости расположения многосеточных зондов). Однако, существенных изменений ни в распределениях электронов по энергиям, ни в пороговых значениях E_0 , такие как и в измеренных ранее значениях $|D|^2$, замечено не было. Отметим, что геометрия входного отверстия зонда и размеры вводимой пластинки исключали возможность попадания в отверстие зонда (ось зонда направлена вдоль \vec{E}) электронов, выходящих непосредственно с ближайших боковых стенок волновода. Введение медной пластинки в волновод, существенно изменившей условия для появления быстрых электронов со "стенок" (при этом сильно изменялась геометрия, материалы и т.п.), не давало заметного изменения результатов измерений, что свидетельствовало в пользу "плазменного" происхождения электронов. Кроме того полученные результаты говорят о том, что введение в плазму миниатюрных металлических тел, например, экранированных зондов, не должно существенно сказываться на протекании процессов поглощения и нагрева электронов в плазме, по крайней мере, для коротких СВЧ импульсов длительностью не выше 0,5 мксек.

Поступила в редакцию
24 апреля 1973 г.

Л и т е р а т у р а

1. И. Р. Геккер, О. В. Сизухин. Письма в ЖЭТФ, 9, 108 (1969).
2. И. Р. Геккер, О. В. Сизухин. Труды 9-ой Между. конф. по явл. в иониз. газах, Бухарест, 1969 г., стр. 542; препринт ФИАН, № 61, 1969 г.
3. К. Ф. Сергеичев, Е. Е. Трофимов. Письма в ЖЭТФ, 13, 236 (1971).
4. В. И. Барников, И. Р. Геккер, О. В. Сизухин, Э. Г. Хачатуров. Краткие сообщения по Физике ФИАН, № 3, 41 (1971); препринт ФИАН № 25, 1971 г.
5. К. Ф. Сергеичев. Труды 9-ой Между. конф. по явл. в иониз. газах, Бухарест, 1969 г., стр. 540; препринт ФИАН, № 61 стр. II, 1969 г.

6. И. Р. Геккер, К. Ф. Сергеичев, В. Е. Трофимов. Труды 8-ой Международной конференции по явлениям в ионизирующих газах, Вена, 1967 г., стр. 395.
7. В. И. Баринов, И. Р. Геккер, В. А. Иванов. Письма в ЖЭТФ, (1973) (в печати).
8. В. И. Баринов. Краткие сообщения по физике ФИАН, № 6, 8 (1971).
9. Н. Е. Аудреев, А. Д. Кирий, В. П. Селин. ЖЭТФ, 57, 1024 (1969).